

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和3年10月14日(2021.10.14)

【公表番号】特表2020-533164(P2020-533164A)

【公表日】令和2年11月19日(2020.11.19)

【年通号数】公開・登録公報2020-047

【出願番号】特願2020-514177(P2020-514177)

【国際特許分類】

B 01 J	29/76	(2006.01)
C 01 B	39/48	(2006.01)
B 01 D	53/86	(2006.01)
B 01 D	53/94	(2006.01)
F 01 N	3/08	(2006.01)
F 01 N	3/10	(2006.01)

【F I】

B 01 J	29/76	A
C 01 B	39/48	Z A B
B 01 D	53/86	2 2 2
B 01 D	53/94	2 2 2
F 01 N	3/08	B
F 01 N	3/10	A

【手続補正書】

【提出日】令和3年9月2日(2021.9.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項17

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項17】

前記触媒基材がウォールフローフィルター基材又はフロースルーベースを含むハニカムである、請求項16に記載の触媒物品。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項20】

前記排気ガス中のNO_xレベルを200～約600の間の温度でN₂及び水に還元する、請求項19に記載の方法。